

電漿電源. 離子源. 質流量計之鍍膜應用研討會訓練班

- ◎ 課程簡介：現今儘管科技進步神速，各種 3C 產品發展蓬勃，各式感測器或穿戴式產品日益成熟，這其中薄膜技術一直扮演重要之角色，在薄膜技術中常藉以電漿源或離子源提供鍍膜時之額外能量，使得鍍膜之基板溫度降低且薄膜品質更佳，為得穩定之電漿源或離子源，質流量計擔任一穩定供應氣體流量之功能。本次課程將深入淺出介紹電漿電源、離子源與質流量計之工作原理，說明其對鍍膜技術與薄膜品質之影響，並搭配實驗課程與實體展示，提供學員除課堂授課外，又可眼見為憑之學習機會。

- ◎ 主辦單位：台灣真空學會
- ◎ 協辦單位：國立中興大學
- ◎ 適合對象：對於電漿電源、離子源、質流量計鍍膜技術有興趣者
- ◎ 課程日期：2015 年 5 月 14 日（星期四）
- ◎ 課程地點：國立中興大學-雲平樓
- ◎ 招收人數：以 60 位為限，額滿截止報名。
- ◎ 報名方式：登入學會網站線上報名系統填妥報名資料，「提交」送出後，再請盡速將匯款繳費證明回傳至本學會信箱：taiwanvacuum@taiwanvacuum.org，即完成報名手續。
- ◎ 費用：課程原價 **3,000 元**
 1. 學會會員優惠價 **2,400 元**；憑有效學生證，學生優惠價 **2,100 元**。
 2. 三人（含）以上一同報名者，每人費用再享 **200 元** 折價優惠。
- ◎ 繳款方式：
 1. 郵政劃撥—帳號：11136742；戶名：台灣真空學會
 2. ATM 轉帳—銀行代碼：017（兆豐國際商業銀行）；帳號：02009-107351
- ◎ 受訓證明：全程上課及完成課程者，於課後頒發台灣真空學會結業證書。

| 時 間 | | 課 程 內 容 | 講 師 |
|-------------|-------------|---------------------------------------|-------|
| 5/14 (四) | 08:40~09:00 | 報到／班主任致歡迎詞 (洪瑞華院長) | |
| | 09:00~10:30 | 質流量計原理及製程應用 | 陳景昇 |
| | 10:30~10:40 | 茶敘 | |
| | 10:40~12:10 | 離子源-鍍膜與蝕刻應用 | 劉奕亮 |
| | 12:10~13:30 | 午餐 | |
| | 13:30~15:00 | 製程系統參觀+解說 | 實驗室 A |
| | 15:00~15:30 | 茶敘 | |
| | 15:30~17:00 | 製程系統參觀+解說 | 實驗室 B |
| | 17:00~17:30 | 分組報告、總結與檢討 分組操作成果報告、課程總結與檢討、頒發畢業證書 | 洪瑞華 |